

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成21年11月26日(2009.11.26)

【公表番号】特表2009-520184(P2009-520184A)

【公表日】平成21年5月21日(2009.5.21)

【年通号数】公開・登録公報2009-020

【出願番号】特願2008-545683(P2008-545683)

【国際特許分類】

G 0 1 J 3/46 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 J 3/46 Z

【手続補正書】

【提出日】平成21年10月9日(2009.10.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の第 1 の領域を有する少なくとも 1 つの第 1 の光ビーム (1 1 4) を生成するステップであって、前記第 1 の領域のうち少なくとも 2 つはスペクトル的に異なる、ステップと、

前記少なくとも 1 つの第 1 の光ビーム (1 1 4) を使用して少なくとも 1 つの第 2 の光ビーム (1 1 8) 及び少なくとも 1 つの第 3 の光ビーム (1 2 0) を生成するステップであって、前記少なくとも 1 つの第 2 の光ビーム (1 1 8) は複数の第 2 の領域を有し、前記少なくとも 1 つの第 3 の光ビーム (1 2 0) は複数の第 3 の領域を有し、前記第 2 の領域のうち少なくとも 2 つはスペクトル的に異なり、前記第 3 の領域のうち少なくとも 2 つはスペクトル的に異なる、ステップと、

前記第 2 の領域の各々について複数の第 1 の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定するステップと、

前記少なくとも 1 つの第 3 の光ビーム (1 2 0) で対象 (1 0 2) の少なくとも一部を照射して、少なくとも 1 つの第 4 の光ビーム (1 2 6) を生成するステップであって、前記少なくとも 1 つの第 4 の光ビーム (1 2 6) は複数の第 4 の領域を有し、前記第 4 の領域のうち少なくとも 2 つはスペクトル的に異なる、ステップと、

前記第 4 の領域の各々について複数の第 2 の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定するステップと、

前記測定されたスペクトルの少なくとも幾つかを使用して前記対象 (1 0 2) の放射伝達因子を識別するステップとを具備する方法。

【請求項 2】

前記第 1 の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定する前記ステップは、第 1 の検出器 (1 2 4) を使用するステップを含み、

前記第 2 の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定する前記ステップは、第 2 の検出器 (1 3 2) を使用するステップを含み、前記方法は、

前記第 1 及び第 2 の検出器 (1 2 4 、 1 3 2) を調整するステップをさらに具備する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記対象 (1 0 2) の少なくとも一部の照射を中断するステップをさらに具備し、

前記第4の領域の各々について複数の第2の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定する前記ステップは、照射を中断する前記ステップの前及び後の両方において、前記第4の領域の各々について前記複数の第2の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定するステップを含み、

前記放射伝達因子はリン光放射伝達因子を含む請求項1に記載の方法。

【請求項4】

少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第1の領域を含む少なくとも1つの第1の光ビーム(114)を生成することができ、

前記少なくとも1つの第1の光ビーム(114)を使用して、少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第2の領域を含む少なくとも1つの第2の光ビーム(118)及び少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第3の領域を含む少なくとも1つの第3の光ビーム(120)を生成することができる、ビーム生成器と、

前記第2の領域の各々について複数の第1の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定することができる第1の検出器(124)と、

少なくとも1つの第4の光ビーム(126)の複数の第4の領域の各々について複数の第2の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定することができる第2の検出器(132)であって、前記第4の領域のうち少なくとも2つはスペクトル的に異なり、前記少なくとも1つの第4の光ビーム(126)は、前記少なくとも1つの第3の光ビーム(120)で対象(102)の少なくとも一部を照射することにより生成される、第2の検出器(132)とを具備する装置。

【請求項5】

少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第1の領域を含む少なくとも1つの第1の光ビーム(114)を生成することができ、

前記少なくとも1つの第1の光ビーム(114)を使用して、少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第2の領域を含む少なくとも1つの第2の光ビーム(118)及び少なくとも2つの領域がスペクトル的に異なる複数の第3の領域を含む少なくとも1つの第3の光ビーム(120)を生成することができる、ビーム生成手段と、

前記第2の領域の各々について複数の第1の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定することができる第1の測定手段(124)と、

少なくとも1つの第4の光ビーム(126)の複数の第4の領域の各々について複数の第2の波長帯域の各々におけるスペクトルを測定することができる第2の測定手段(132)であって、前記第4の領域のうち少なくとも2つはスペクトル的に異なり、前記少なくとも1つの第4の光ビーム(126)は、前記少なくとも1つの第3の光ビーム(120)で対象(102)の少なくとも一部を照射することにより生成される、第2の測定手段(132)とを具備する装置。